PAT-NO:

JP406037231A

DOCUMENT-

JP 06037231 A

IDENTIFIER:

TITLE:

LEAD FRAME AND RESIN MOLDED SEMICONDUCTOR DEVICE

USING THE SAME

PUBN-DATE:

February 10, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FURUKAWA, MITSUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

HITACHI YONEZAWA ELECTRON CO LTD N/A

APPL-NO: JP04190375

APPL-DATE: July 17, 1992

INT-CL

H01L023/50 , B29C043/18 , B29C045/02 , H01L021/56 ,

(IPC):

H01L023/28

ABSTRACT:

PURPOSE: To secure the discharging function of the air <u>vents</u> of a metallic <u>mold</u> by a method wherein through holes, a cavity part or a rough surface part are provided in air <u>vent</u> parts so that the resin having entered the air <u>vent</u> parts may adhere to the <u>lead frame</u> side only.

CONSTITUTION: The resin 5 poured from the gate of a metallic mold enters a cavity while discharging the air from the air vents of the metallic mold finally entering the air vents so as to fill up the through holes 3 provided in the air vent parts 2a, 2b, 2c. Next, when the metallic mold is opened after it is filled up with the resin 5 entering the through holes 5, the resin 5 entering the air vents of

the metallic <u>mold</u> is to adhere to the <u>lead frame</u> la side only not to the metallic <u>mold</u> side due to the reinforced adhesion of the resin 5 and the <u>lead frame</u> la so that the air <u>vents</u> of the metallic <u>mold</u> may not be blocked up with any residual resin 5 thereby ensuring the air discharging function.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-37231

(43)公開日 平成6年(1994)2月10日

(51)Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 23/50 B 2 9 C 43/18 45/02 H 0 1 L 21/56	 識別記号 庁内整理番号 J 9272-4M K 9272-4M 7365-4F 7344-4F H 8617-4M 	· FI 技術表示箇所
		審査請求 未請求 請求項の数4(全 5 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平4-190375	(71)出願人 000005108 株式会社日立製作所
(22)出願日	平成4年(1992)7月17日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地 (71)出願人 000233583 日立米沢電子株式会社 山形県米沢市大字花沢字八木橋東 3 の3274
		(72)発明者 古川 光浩 山形県米沢市大字花沢字八木橋東3の3274 日立米沢電子株式会社内
		(74)代理人 弁理士 筒井 大和
. ·		

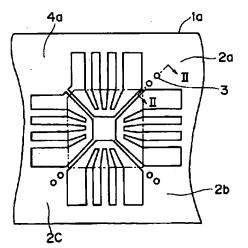
(54)【発明の名称】 リードフレームおよびそれを用いたレジンモールド形半導体装置

(57)【要約】

【目的】 レジンモールド形半導体装置のモールド工程 で、レジン充填後リードフレームの離脱時において、金 型のエアベントに流入したレジンをリードフレーム側に 付着させる。

【構成】 リードフレーム1 aの、レジンモールド時に 金型のエアベントに相当する箇所2 a, 2b, 2cに、 貫通孔3を設ける。

図 1



1 a : リードフレーム 2 a : エアペント部

2 b:エアベント部

2 c:エアベント部

3:貫通孔

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レジンモールド時にモールド金型のエア ベントに相当する箇所の一部または全部に、一または複 数の貫通孔を設けたことを特徴とするリードフレーム。

【請求項2】 前記貫通孔が凹状部であることを特徴と する請求項1記載のリードフレーム。

【請求項3】 前記一または複数の貫通孔が粗面部であ ることを特徴とする請求項1記載のリードフレーム。

【請求項4】 請求項1、2または3記載のリードフレ ームを用いてレジンモールドしてなることを特徴とする 10 レジンモールド形半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、リードフレームに関 し、特にレジンモールド形半導体装置のモールド不足や バルクボイドの発生を防止することのできるリードフレ ームおよびそれを用いたレジンモールド形半導体装置に ついて有効な技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、レジンモールド形半導体装置のモ 20 ールド金型(以下、単に金型という)には、レジンの充 填を完全にするために、レジン充填とともにキャビティ 内のエアが外部に排出されるようにエアベントが設けら れている。

【0003】したがって、金型のキャビティ内にレジン を注入した場合には、このエアベントにもレジンが流入 することとなる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、リードフレー ムとレジンとは密着性が良くないため、このエアベント 30 に流入したレジンはリードフレーム側ではなく金型側に 付着、残留して、金型のエアベントを塞いでしまう。そ して、エアベントが塞がれたままの状態で次の半導体装 置のモールドを行うと、今度はエアがキャビティ内に留 まってレジンの流れを阻害し、モールド不足やバルクボ イドが発生していた。

【0005】すなわち、レジンの充填を完全にするため に設けたエアベント部が、かえって、レジンの充填を不 完全にしてしまうという結果を招いてしまっていた。

【0006】本発明の目的は、エアベントに流入したレ 40 ジンをリードフレーム側に付着させることにより、金型 のエアベントのエア排出機能を確保することのできるリ ードフレーム、およびこれを用いたレジンモールド形半 導体装置に関する技術を提供することにある。

【0007】本発明の前記ならびにその他の目的と新規 な特徴は、本明細書の記述及び添付図面から明らかにな るであろう。

[0008]

【課題を解決するための手段】本願において開示される

りである。

【0009】すなわち、リードフレームの、レジンモー ルド時に金型のエアベントに相当する箇所(以下、単に エアベント部という)に、貫通孔、凹状部または粗面部 を設けたものである。

2

[0010]

【作用】上記のような構成のリードフレームによれば、 レジンモールド時において、金型のゲートから注入され たレジンは、空気を金型のエアベントから排出させつつ キャピティ内に流入していき、最後にこのエアベントに も流入して、エアベント部に設けられた貫通孔、凹状部 または粗面部をも満たす。

【0011】そして、この貫通孔、凹状部または粗面部 へ流入したレジンが、レジン自体とリードフレームとの 付着力を強化することとなるため、レジンの充填が終了 して金型が開かれたときに、金型のエアベントに流入し たレジンは、金型側ではなくリードフレーム側へ付着す ることとなり、残留したレジンによって金型のエアベン トが塞がれることがなくなる。

[0012]

【実施例1】図1は、本発明の実施例を示すリードフレ ーム1aの概略的な平面図、図2は、そのリードフレー ム1aのII-II線における部分拡大断面図、図3は、そ のリードフレーム1aのモールド状態を示す要部断面図 である。

【0013】まず、図1および図2により本実施例のリ ードフレーム1aの構成について説明する。

【0014】本実施例のリードフレーム1aは、エアベ ント部2a, 2b, 2cに複数個のたとえば円形の貫通 孔3を設けたものよりなる。

【0015】すなわち、図1において、左上が金型のゲ ートに相当する箇所(以下、単にゲート部という)4 a で、左下、右上そして右下がエアベント部2a, 2b, 2cとなり、このエアベント部2a, 2b, 2cに図2 のような貫通孔3が設けられている。

【0016】本形状のリードフレーム1aはQFP(ク ワッド・フラット・パッケージ) やPLCC (プラスチ ック・リーディッド・チップ・キャリア)等の四辺リー ドタイプに用いられるものである。

【0017】なお、図1の二点鎖線の内側は、製品とし てのレジンモールド形半導体装置におけるリードフレー ム1aの被モールド領域を示している。

【0018】つぎに、図3により、本実施例におけるリ ードフレーム1aの、エアベント部のレジン5をリード フレーム1 aに付着させる作用について説明する。

【0019】レジンモールド形半導体装置の製造工程に おいては、リードフレーム1 aとチップ (図示せず) と がボンディングされると、これらを外的環境等から保護 するためにレジンモールドがされる。ここで、レジンモ 発明のうち、代表的なものの概要を説明すれば、次の通 50 ールドとは、加熱した上下の金型6a,6bの間に、ボ

ンディングがされた半導体チップ (図示せず)をリード フレーム1 aごとセットして金型6 a, 6 bを閉じ、軟 化したレジン5に圧力をかけて金型6a,6bのゲート 口からキャビティ内に注入して成形することをいい、こ の時、金型6a,6bのエアベント7からキャビティ内 のエアが外部に排出される。

【0020】本実施例のリードフレーム1aがモールド される場合、金型6a,6bのゲートから注入されたレ ジン5はキャビティ内に流入していき、これと同時にキ ャピティ内の空気はこのレジン5に押されるようにエア 10 ベント7から外部に排出される。そして、レジン5は、 最後にこのエアベント7に流入し、ここでレジン5の充 填が完了する。

【0021】このレジン5の充填完了状態を示すのが図 3であり、レジンモールド形半導体装置のパッケージを 構成するレジン5はリードフレーム1 aのエアベント部 2a, 2b, 2cに設けられた貫通孔3にも流入してい る。

【0022】レジン5の充填が完了すると、金型6a, 6 bが上下に開きモールドされたリードフレーム 1 aが 20 取り出されて、レジンモールドが終了するが、ここにお いてレジン5がリードフレーム1aのエアベント部2 a, 2b, 2cの貫通孔3に流入して、レジン5のリー ドフレーム1 a側への付着力が強化されているので、金 型6a,6bが開いたとき、レジン5は金型6a,6b 側ではなくリードフレーム1 a側に付着することとな る。

【0023】レジンモールドされたリードフレーム1a が離脱した金型6a,6bは、さらに次のリードフレー ム1aをレジンモールドするために再び上下を閉じ、レ 30 ジン5が金型6a,6bのゲートからキャビティ内に注 入される。

【0024】ここにおいて、前記のように、金型6a. 6 bのエアベント7にはレジン5が残留していないの で、金型6a、6bのキャビティ内の空気の流出口であ るエアベント7は金型6a,6bが閉じても塞がれるこ とはない。したがって、次回のモールドも、前回と同様 に、空気はレジン5の注入と同時にエアベント7から外 部に排出されてゆき、一方、ゲートから注入されたレジ ン5は、最終的にこのエアベント7に流入して充填が完 40 了する。

【0025】そして、充填が完了して金型6a,6bが 開いたとき、リードフレーム1aのエアベント部2a. 2b, 2cの貫通孔3にレジン5が流入しているので、 レジン5はやはりリードフレーム1a側に付着して、金 型6a,6bから離脱する。

【0026】以降のレジンモールドにおいてもこの工程 が繰り返され、したがって、エアベント7に流入したレ ジン5は常にリードフレーム1a側に付着し、金型6

とはなく、空気排出機能が確保されることとなる。

【0027】それにより、レジンモールド形半導体装置 のモールド工程において、レジン5が注入されても金型 6a, 6bのキャピティ内に空気が留まってレジン5の 完全な充填を妨げたり、最終的にエアベント7に流入す るというレジン5の流れが阻害されることがなくなるの で、レジンモールド形半導体装置のモールド不足やバル クボイドによる不良の発生を防止することができる。

[0028]

【実施例2】図4は、本発明の他の実施例を示すリード フレーム1 bの概略的な平面図、図5は、そのリードフ レーム1bのv-v線における拡大部分断面図である。 【0029】本実施例のリードフレーム1bは、その形 状が二辺リードタイプであり、エアベント部2dに貫通 孔ではなく凹状部8を設けた点で、前記実施例1におけ るリードフレームと異なる。

【0030】すなわち、本実施例のリードフレーム1b については、下方がゲート部46に当り、上方がエアベ ント部2 dに当たる部分で、このエアベント部2 dに凹 状部8が設けられている。

【0031】本実施例の二辺リードタイプのリードフレ ーム1 bはD I P (デュアル・インライン・パッケー ジ) やSOP (スモール・アウトライン・パッケージ) 等に用いられるものである。

【0032】なお、図4の二点鎖線の内側も、図1と同 様に、製品としてのレジンモールド形半導体装置におけ るリードフレーム1bの被モールド領域を示している。 【0033】本実施例のリードフレーム1 bをレジンモ ールドする場合においても、金型6a,6bのゲートか ら注入されたレジン5はキャビティ内に流入していき、 最後にエアベント7に流入して、充填が完了する。

【0034】ここにおいて、エアベント7に流入したレ ジン5はリードフレーム1bの凹状部8にも流入してい るので、エアベント7のレジン5とリードフレーム1 b との接着面積が増加してレジン5のリードフレーム1 b 側への付着力が強化されており、金型6a,6bが開い たとき、やはりレジン5は金型6a,6b側ではなくリ ードフレーム1b側に付着することとなる。

【0035】したがって、本実施例におけるリードフレ ーム1bにおいても、レジン5は金型6a, 6bのエア ベント7には残留せずに、エアベント7の空気排出機能 が確保されるので、次回のレジンモールドにおいて、レ ジン5の注入時に金型6a,6bのキャビティ内に空気 が留まることがなく、レジンモールド形半導体装置のモ ールド不足やバルクボイドによる不良の発生を防止する ことができる。

[0036]

【実施例3】図6は、本発明の他の実施例を示すリード フレーム1 cのエアベント部の部分拡大断面図である。 a, 6 bのエアベント7がレジン5によって塞がれるこ 50 【0037】本実施例のリードフレーム1 cは、エアベ

ント部に粗面部9を設けた点で、前記実施例1および2 と異なる。

【0038】本実施例のリードフレーム1cをレジンモ ールドした場合も、レジン5はエアベント部である粗面 部9にも流入し、その結果レジン5とリードフレーム1 cとの接着面積が増加してレジン5のリードフレーム1 c側への付着力が強化される。

【0039】したがって、前記実施例1および2におけ るリードフレームの場合と同様に、本実施例におけるリ ードフレーム1 c においても、金型6 a 、6 b が上下に 10 開いたときに、レジン5はリードフレーム1 c 側に付着 しエアベント7の空気排出機能が確保されるので、レジ ンモールド形半導体装置のモールド不足やバルクボイド による不良の発生を防止することができる。

【0040】以上、本発明者によってなされた発明を実 施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲 で種々変更可能であることは言うまでもない。

【0041】たとえば、実施例1および2において、貫 通孔の設けられた四辺リードタイプのリードフレーム、 および凹状部の設けられた二辺リードタイプのリードフ レームについて説明したが、本発明はこの組合せに限定 されるものではなく、したがって、どの様な形状のリー ドフレームであっても、エアベント部に貫通孔、凹状部 または粗面部が設けられていればよい。

【0042】また、貫通孔や凹状部の形状については、 本実施例では円形のものについて説明したが、楕円形、 三角形あるいは四角形など種々の形状が可能であり、そ の個数についても、必ずしも複数であることを要せず、 エアベント部の面積、レジンの種類あるいはリードフレ 30 ームの材質によって、一個の貫通孔または凹状部でレジ ンのリードフレームへの十分な付着力が得られる場合に は、一個であってもよい。

【0043】同様に、粗面部の形状についても、エアベ ント部の表面があらい面である限り本実施例の形状には 限定されず、また、その広さについても自由に設定する ことができる。

【0044】さらに、金型のエアベントが複数箇所ある 場合においては、全てのエアベント部のレジンをリード フレームに付着させることができるならば、リードフレ 40 ームのエアベント部の全ての箇所に貫通孔、凹状部また は粗面部を設けなくてもよい。

【0045】加えて、本発明のリードフレームは、レジ ンモールド形半導体装置にのみ適用されるものではな く、たとえば、リードフレーム上に形成されたインサー ト部材をレジンにてモールドして製品化するような場合 におけるそのリードフレームについても適用することが 可能である。

[0046]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち、代 50 6 b 金型

表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば下 記の通りである。

【0047】(1) すなわち、本発明のリードフレームに よれば、エアベント部に貫通孔、凹状部または粗面部を 設けることにより、金型のエアベントに流入したレジン は、金型側ではなくリードフレーム側に付着するので、 残留したレジンによる金型のエアベントの詰まりがなく なる。

【0048】(2).その結果、レジン充填時に金型のキャ ビティ内の空気を速やかに外部に排出するというエアベ ントの機能を保持することができ、レジンが金型のキャ ビティ内に完全に充填されることとなり、エアベントの 詰まりによるモールド不足やバルクボイドの発生がなく なり、歩留りが向上する。

【0049】(3).また、エアベント部の貫通孔または凹 状部を複数設けた場合には、付着力が与えられた貫通孔 等が相互に相俟っていわゆるブリッジ効果を発生させる ので、各貫通孔等の付着力の総和以上の付着力が得られ

20 【0050】(4).さらに、外的環境や機械的振動から半 導体チップ等を保護するというモールドの機能が確実に 担保され、信頼性の高いレジンモールド形半導体装置を 製造することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1を示すリードフレームの概略 的平面図である。

【図2】図1のリードフレームのII-II線における拡大 部分断面図である。

【図3】図1のリードフレームのモールド状態を示すレ ジンモールド形半導体装置の要部断面図である。

【図4】本発明の実施例2を示すリードフレームの概略・ 的平面図である。

【図5】図4のリードフレームのマーマ線における拡大 部分断面図である。

【図6】本発明の実施例3を示すリードフレームの拡大 部分断面図である。

【符号の説明】

1a リードフレーム

1b リードフレーム

1c リードフレーム

2a エアベント部

2b エアベント部

2c エアベント部

2d エアベント部

3 貫通孔

4a ゲート部

4 b ゲート部

5 レジン

6 a 金型

(51) Int. Cl.⁵ H01L 23/28

庁内整理番号 A 8617-4M

FΙ

技術表示箇所

// B29L 31:34

4 F